09/849684

CLIPPEDIMAGE= JP401277600A

PAT-NO: JP401277600A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01277600 A

TITLE: TERMINAL POINT DETECTION METHOD AND DEVICE FOR

DRYING PROCESS IN DRY

CLEANING

PUBN-DATE: November 8, 1989

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

NAYA, KAZUNARI SEGAWA, HIDEO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NIPPON MINING CO LTD

N/A

APPL-NO: JP63108828

APPL-DATE: April 28, 1988

INT-CL (IPC): D06F043/08;G01N027/12

US-CL-CURRENT: 68/18C

ABSTRACT:

PURPOSE: To improve the efficiency of work for determining the terminal point in drying operation, by regulating the voltage to be applied to a heating device for a gas sensor to increase its response to dry cleaning solvent vapor by making a semiconductor detecting element work at a specified temperature.

CONSTITUTION: A gas sensor @S consists of a semiconductor detecting element and a heating device HT, and a temperature compensation circuit TC consists of resistor R<SB>1</SB>∼R<SB>3</SB> and a thermistor TH. The temperature compensation circuit TC controls the voltage to be applied to the heating device HT so as to heat the semiconductor detecting element up to

440∼500°C. As a result, the response to the dry cleaning solvent vapor is increased so that the efficiency of work for determining the terminal point in drying operation can be improved.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio

19日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

◎ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-277600

⑤Int. Cl. ¹

識別記号 庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)11月8日

日本鉱業株式会社内

D 06 F 43/08 G 01 N 27/12 B-8418-4L A-8105-2G

審査請求 未請求 請求項の数 5 (全9頁)

60発明の名称

ドライクリーニング溶剤の乾燥終了点検知方法および装置

②特 願 昭63-108828

②出 願 昭63(1988) 4月28日

@発明者 納屋

一成

埼玉県戸田市新曾南 3 丁目17番35号 日本鉱業株式会社内

⑩発 明 者 瀬 川 秀 夫 ⑪出 願 人 日本鉱業株式会社 埼玉県戸田市新曾南3丁目17番35号 東京都港区虎ノ門2丁目10番1号

四代 理 人 弁理士 大日方 富雄

外1名

明 期 書

1.発明の名称

ドライクリーニング溶剤の乾燥終了点検知方法 および装置

2. 特許請求の範囲

(1) 半導体検出素子と加熱手段とからなるガスセンサを用いたドライクリーニング溶剤の乾燥終了点検知方法において、上記半導体検出素子が440℃~500℃に加熱されるように上記加熱手段への印加電圧を制御するようにしたことを特徴とするドライクリーニング溶剤の乾燥終了点検知方法。

(2) ガスセンサと、該ガスセンサに被検出ガスを供給するガス吸引手段とを備えたドライクリーニング溶剤乾燥終了点検知装置において、上記ガス吸引手段を常時低速で回転させておき、測定時には回転数を高くするようにしたことを特徴とするドライクリーニング溶剤の乾燥終了点検知方法。(3) 簡状をなす本体の一端開口部に対応してガスセンサとガス吸引手段を配置してなるドライク

リーニング溶剤乾燥終了点検知装置において、上記ガスセンサを上記筒状をなす本体の内部に本体の関口部を対向させて固定、あるいは上記筒状をなす本体の内部壁面にセンサを固定したことを特徴とするドライクリーニング溶剤の乾燥終了検知装置。

(5) 筒状をなす本体の一端関口部に対応してガスセンサとガス吸引手段を配置してなるドライク リーリング溶剤乾燥終了点検知装置において、上 記ガスセンサおよびガス吸引手段と他の部分との 個にガスに対する隔壁を設けたことを特徴とする ドライクリーニング溶剤の乾燥終了点検知装置。

3. 発明の詳細な説明

、[産業上の利用分野]

この発明は、ガス濃度測定技術に関し、特にド ライクリーニング溶剤の衣類残留濃度の測定装置 に利用して効果的な技術に関する。

[従来の技術とその問題点]

従来、ドライクリーニング後の衣類に残留している溶剤の乾燥状態の判定は、作業者の嗅覚による感に頼っていた。そのため、正確な乾燥終了点の判定を行なうためには、優れた嗅覚と長い経験を必要とするとともに、判定結果に個人差が生じ易いという問題点があった。

また、ドライクリーニング溶剤には洗浄力の他 に安全性の高いことが要求されるが、そのような 性能を追及した結果、無臭のドライクリーニング 溶剤も開発されている。

従って、このような溶剤を使用した場合、人間

対する広答性を高めるとともに判定後の復帰時間 の短縮を図り、もって乾燥終了判定作業の能率を 向上させることにある。

[課題を解決するための手段]

上記目的を達成するため本発明は、半導体検出 素子とその加熱手段とからなる熱線型半導体ガス センサを用い、このセンサの出力電圧が所定のレ ベルに達したか否か判定することによりドライク リーニング溶剤の乾燥終了点を検知する方法にお いて、上記ガスセンサの加熱手段への印加電圧を 制御して素子温度を440℃乃至500℃にして 作動させるようにした。

また、ガスセンサの関口部が筒状をなす本体の 一端関口部に対向するように配置して、ガスセン サにガスが接触しやすいようにした。

さらに、非測定時にガスセンサ周辺にガスが滞留しないように、非測定時にもガスの吸引を行な うファンを低速で回転させておくようにした。

さらにガスセンサおよびガス吸引手段と他の部 分との間に隔壁を設け、他の部分、特に回路部分・ の嗅覚と感による従来の乾燥状態の判定は非常に 困難なものとなり、未乾燥の衣類を出荷するといった事故が発生する可能性が高くなる。 未乾燥の 衣類を出荷した場合、着用者の皮膚に炎症を発生 させる原因となり、大きな問題となっている。

このように問題点を解決するため、本出版人は 先に、ドライクリーニング溶剤の乾燥終了点を 報配を開発している(特願昭62-291427 身)。この装置により、従来は作業者の感と殺戮 になったが緩和中定が強にでするになった。 はドライクリーニング溶剤気に対する応生を はドライクリーニング溶剤気に対する応生を なが、判定をは果が確定がませた。 での時間及び、判定後に表示が操作的の状態に での時間及び、判定後に表示が操作的の状態に の時間が長いといった不具合があった。

さらに、駆動表示回路部が吸入ガスにさらされる配置であると、回路部品が劣化するおそれがあるという欠点があった。

本発明は上記先顧発明の改良に関し、その目的とするところは、ドライクリーニング溶剤蒸気に

等にガスが接触しないようにした。

[作用]

上記手段によれば素子温度を440℃乃至500℃としたので、分子量の大きなガスの半導体検出素子との吸着・離脱が促進され、灯油、軽油等のドライクリーニング溶剤の蒸気に対する応答性を高めることができる。

さらに、ガスの吸引を常時行なっているため、 装置本体内に前回の検出ガスが残留しにくくなっ て復帰時間が短縮されるようになる。

さらに隔壁を設けたことで、回路部品のガスに 対する保護が図られる。

[実施例]

第1 図には、本発明に係るハンディタイプのドライクリーニング溶剤乾燥料了点検知装置の一実施例が示されている。

この実施例の乾燥終了点検知装置は、全体がくの字形をなすように形成された円筒状の装置本体 1の一端閉口部に、ステンレス製メッシュを有す る防塵部材2が装着されている。その防塵部材2 の後方の装置本体1内には、熱線型半導体式ガス センサ3が配置され、さらにその後方には8枚羽 根のファン4とその駆動用モータ5が配置され、 上記ファン4を回転させると防塵部材2が装着された開口部より空気吸入されてガスセンサ3による もた、ファン4により吸入されたエアーが外部へ 速やかに排出されるように、装置本体1の上端折 曲部にエアー排出口6が形成されている。

さらにファンにより吸引されたエアーおよびガスが他の部分特に回路基板11や12に接触しないように、隔壁16が形成されている。

なお、ガスセンサ3の取付け基板3aには、ガスセンサの前方に位置するように、温度センサとしてのサーミスタTHが取付けられている。

さらに、第1図において、右下がりに傾斜して 図示されている装置本体1の円筒部は、装置の把 手部となる部位であり、この把手部1aには、上 記ファン4の駆動用モータ5を始動させるための ハンドスイッチの操作ポタン7が、その一部が本 体1より舞出するように設けられている。この操作ボタン7は弾力性を有し、その一輪は(図では下輪)本体1の内壁に固定され、他蝠(図では上端)が自由輪とされている。そして、この操作ボタン7の背面に対向するように、マイクロスイッチ8が、装板12上に取り付けられている。

そして、上記基板11とこれと平行な基板12 上に、上記表示用発光ダイオードLED、~LE D、、やガスセンサ3、ファン駆動用モータ5を制御する制御回路としての乾燥検出回路とその電源

函路(ともに図示省略)が搭載されている。

なお、第1図において、符号13で示されているのは、電源回路を構成するトランスであり、15 は給電用コード14の挿入口である。

この実施例のガスセンサ3は、第3図(A)に示すように、セラミック製基板31に2対の電極ピン32,33が貫通され、このうち一方の電極ピン間に、SnO,からなる検出来子34が、また他方の電極ピン間にヒータ(図示省略)が接続されている。そして、上記検出来子34の上方を覆おうようにステンレス製のカバー35が設けられている。このカバー35はセラミック基板31の外間に嵌合する保持枠35aと、半球状のメッシュ部35bとからなる。

ガスセンサを第1図の装置内に取り付ける場合、ガスの流れを円滑にするには、取付け基板3 a を流れの向きと平行にする必要がある。しかし、そのようにすると第3図(B)のような構造のセンサでは、吸入したガスが素子と平行に流れるため、ガスがメッシュ35 b を通って内側に入りにくく

なり兼子に接触するガスの量が少なくなる。これに対し、第3回(A)のような半球状メッシュ35bを有するセンサを用いると、取付け基板3aを流れと平行に配置しても吸入されたガスがメッシュ内に充分に流入して兼子34に接触するようになるので、感度が向上する場合は、第7回のように、ガスセンサの関口部を本体関口部に対向させることで素子に接触するガスの量を増すことができるので、感度が向上する。

また、半導体ガスセンサを使用しているため、 応度が良好で、信頼性、耐久性に優れ、無臭の宿 剤に対しても乾燥終了点を適確に知ることができ るとともに、ファンによる自動吸引式を採用している。 は赤、炭、緑の3色で12段階の乾燥状態表示を でえるようになっているため、経験のない 強度が特に優れていない人であっても正確に乾燥 終了点の判定を行なうことができる。

なお、実施例ではガスセンサの後方にファンを

配置しているが、逆であっても構わない。

第2回には、上記乾燥終了点検知装置本体内に 内蔵される判定制御装置の一部を構成するガス濃 度検出回路の一実施例が示されている。

同図において、符号GSで示されているのは熱 線型半導体式ガスセンサで、センサ内のヒータH Tは電源投入と同時に給電され、楽子を加熱する。 この加熱された状態で楽子内のSnO。結晶が n 型半導体として作用し、端子A-B間の抵抗が雰 囲気のガス組成に応じて変化する。

この実施例では、センサGSに駆動電圧を供給するためのトランジスタTRが電源電圧VccとセンサGSの一方の端子Aとの間に、またセンサGSの抵抗値のパラツキを補償するための可変抵抗・VRがセンサGSの他方の端子Bと接地点との間に、それぞれ接続されている。

また、上記トランジスタTRのベース端子側には、抵抗R1, R2, R3とサーミスタTHとからなる温度補償回路TCが設けられている。抵抗R1, R2, R,は、電源電圧Vccと接地点GND

ダンスを安定化させるように作用している。また、トランジスタTRは、ガスセンサGSの抵抗値が 温度に伴って変化しても印加電圧を一定に保つパッファとして作用する。

また、ガスセンサG S は、検出対象たるガスの種類によっても抵抗値が変化する。ただしその場合においても、ガス濃度と抵抗値との関係は同じであり、グラフ上では各々の特性を示す線が互いに平行となる。従って、検出したいガスの種類が異なるときには、上記可変抵抗 V R の抵抗値 R V を調整することで出力 V o u t のレベルと検出濃度とを一致させることができる。

さらに、この実施例では、ヒータHTに印加される電圧VHを制御して素子が440~500℃ に加熱されるようにしている。

すなわち、SnOュ 結晶を検出素子とするガス センサでは、ヒータへの印加電圧VHと、そのヒータによって加熱される素子の温度とは第5図に示すような関係になり、印加電圧VHが大きいほど温度は高くなる。しかも、このときヒータへの

なお、Vn.はノードn.の電位、VBEはトランジスタTRのペース・エミッタ間電圧で約0.7Vである。

温度補債回路TCのノードn」とトランジスタ TRのペース端子との間に接続された抵抗 R→は、 ノードn」から見たトランジスタTRのインピー

第4回には上記ガス濃度検出回路をドライクリーニング溶剤乾燥終了点検知装置に内蔵される判定制御装置に適用した場合の一実施例が示されて

同図において符号21で示されているが、第2 図に示されているガス濃度検出回路であり、ガス 濃度路出回路20で交流電源から直流に電源に変換された電源電圧Vccが供給可能にされて変換された電源電圧Vccが供給可能にされての装置本体1内に設けられているファン解動用モータ5に給電がなされて、ファン4が常時低速で回転されるとともに、ハンドスイッチのオンによって、トランジスタQ」の電流が増加され、ファンの回転数が増加されるようになっている。さらに、ガス濃度検出回路21内のガスセンサGSのヒータHTには、抵抗R。およびシェナーダイオード2D」、2D。からなる保護回路をが供給され、440℃~500℃まで加熱されるようになっている。

第4図の実施例においては、ガス濃度検出回路 21の出力電圧VoutがA/D変換機能を内蔵 したLEDドライバLDRに入力され、検出され たガス濃度が、12段階に分割されたレベルのど のレベルに相当するかLEDドライバLDRで判

先ずトランジスタQ₂に電流が流れて2分間発光 ダイオードLED₁~D₁₂がすべて点灯され、そ の後トランジスタQ₂がオフして、発光ダイオー ドLED₁~LED₁₁が消灯されて緑色発光ダイ オードLED₁₂のみが点灯されるようになる。

さらに、この実施例では電源投入時に電源が入ったことを音によって知らせるため、タイマ回路 T M 』と発掘回路 2 9 およびブザー 3 0 が設けられている。タイマ回路 T M 』は、タイマ回路 T M 』と同じく C R 時定数型回路で構成され、電源投入後約0。2 秒間ハイレベルの信号を出力するように内部の抵抗と容量の値が決定されている。このタイマ回路 T M 』の出力信号が N O R ゲート G 』を介して発振回路 2 9 に供給されて 0。2 秒間発振信号を出力させ、ブザー 3 0 を鳴動させるようになっている。

またこの実施例では、電源投入時に発光ダイオードLED、~LED、2の全部の点灯状態が2分後に緑色1つのみの点灯に変わるときと、ハンドスイッチをオンしたときに、それぞれブザーを鳴

定して12個の発光ダイオードが1列に並んだし EDアレイレーARYを駆動する。これによって、 LEDアレイレーARYは、ガス濃度が高いほど 多くのLEDが点灯され、検出したガス濃度をア ナログ的に表示できる。

しかも、発光ダイオードを検出レベルに応じて 3色に分割して濃度が高いと緑から赤までが点灯 され、濃度が低いと黄色と緑または緑のみが点灯 されるようにしてあるので作業者による判断が容 品になる。

また、この実施例の図路においては、電源投入 後、ガスセンサGSのヒータHTが所定の温度に 上昇されてセンサの検出能力が安定するまでに、 1分以上要するので、この不安定な期間を無効に するため、CR時定数型のタイマ回路TM,が設けられている。このタイマ回路TM,は、電源投入 入後、約2分間ハイレベルのウェイト信号twを 出力し、その信号が発光ダイオードLED,へ ED,1を駆動可能なトランジスタQ,のベースに 供給される。これによって、電源が投入されると

動させるため、トリガパルス発生回路27と単安 定マルチパイプレータ28とが設けられている。 トリガパルス発生回路27には前記タイマTM。 の出力をインパータINVで反転した信号と、接 点S、からの信号の2つが入力されている。そし て、トリガパルス発生回路27はこれらの信号の ロウレベルからハイレベルへの立上りエッジを検 出して、いずれか一つの信号が立ち上がったとき に、ヒゲ状のトリガパルスTPを発生する。この トリガパルスTPによって単安定マルチパイブレ ータ28が起動されてパルス幅が引き伸ばされ、 例えばり、1秒の幅のパルスが形成される。この パルスが上記NORゲートG、を介して発援回路 29に供給され、これを0.1秒間動作させるこ とにより、ブザー30が鳴動されるように構成さ れている。

[発明の効果]

以上説明したようにこの発明は、半導体検出表 子とその加熱手段とからなる熱線型半導体ガスセ ンサを用い、このセンサの出力電圧が所定のレベ ルに達したか否か判定することによりドライクリーニング溶剤の乾燥終了点を検知する方法において、上記ガスセンサの加熱手段への印加電圧を制御して素子温度を440℃乃至500℃にして作動させるようにしたので、分子量の大きなガスのガスセンサ素子との吸着・離脱が促進され、灯油、軽油等のドライクリーニング溶剤蒸気に対する応替性を高めることができる。

また、ガスセンサの関口部が筒状をなす本体の 一幅関口部に対向するように配置して、ガスセン サにガスが接触しやすいようにしたことにより感 度が向上する。

さらに、ガスの吸引を行なうファンを非測定時 にも低速で回転させておくようにしたので、装置 本体内に前回の検出ガスが残留しにくくなって復 帰時間が短縮されるようになる。

これによってドライクリーニング溶剤の乾燥終 了検出作業の能率が大幅に向上するという効果が 得られる。

さらにガスセンサおよびガス吸引手段と他の部

第6 圏はガスセンサのヒータへの印加電圧と出 力電圧の復帰に要する時間との関係を示すグラフ、

第7 図は、第3 図(B)のガスセンサを用いた本発明に係るドライクリーニング溶剤乾燥終了点 検知装置の一実施例を示す断面傾面図である。

・・ブザー、TM., TM.・・・タイマ回路 代理人 弁理士 大日方宮雄 弁理士 茂船博 可信 分との間に隔壁を設けたことによって、回路部品のガスに対する保護が図られ信頼性が向上する。 4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明に係るドライクリーニング溶 剤の乾燥終了点検知装置の一実施例を示す断面側 面図(ガスセンサは第3図(A)の構造のものを 用いた例)、

第2 図は、上記乾燥終了点検知装置に使用されるのに好適なガス濃度検出回路の一実施例を示す 回路図

第3図(A)は本発明に係るドライクリーニング溶剤の乾燥終了点検知装置に使用されるガスセンサの構成例を示す断面図、

第3 図 (B) は本発明に係るドライクリーニング溶剤の乾燥終了点検知装置に使用されるもうー 種のガスセンサの構成例を示す斯面図、

第4 図は、上記ガス濃度検出回路を用いた判定 制御回路の一実施例を示す回路図、

第5 図は、ガスセンサのヒータへの印加電圧と 素子温度との関係を示すグラフ、













